

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 3 区分

【発行日】平成25年8月8日 (2013.8.8)

【公表番号】特表2013-500869(P2013-500869A)

【公表日】平成25年1月10日 (2013.1.10)

【年通号数】公開・登録公報2013-002

【出願番号】特願2012-522914(P2012-522914)

【国際特許分類】

B 2 4 D 11/00 (2006.01)

B 2 3 K 26/36 (2006.01)

B 2 3 K 26/00 (2006.01)

【F I】

B 2 4 D 11/00 Q

B 2 3 K 26/36

B 2 3 K 26/00 G

B 2 3 K 26/00 N

【手続補正書】

【提出日】平成25年6月19日 (2013.6.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被覆研磨物品であって、

裏材に固定された研磨層であって、該研磨層が、少なくとも 1 種の結合剤によって、該裏材の第 1 の主表面に固定される研磨粒子を含む、研磨層と、

前記研磨層の少なくとも一部に配置されるスーパーサイズと、を含み、

前記被覆研磨物品が、前記被覆研磨物品の縁部に隣接する溶融流れゾーンを有し、該溶融流れゾーンが、100 マイクロメートル未満の最大幅を有し、該溶融流れゾーンが、40 マイクロメートル未満の最大高さを有する、被覆研磨物品。

【請求項 2】

少なくとも 1 種の結合剤によって裏材の第 1 の主表面に固定される研磨粒子を含む被覆研磨物品を用意することと、

前記被覆研磨物品の第 1 の構成要素に対応する第 1 の吸収スペクトルの少なくとも一部を得ることと、

前記第 1 の吸収スペクトルの第 1 の吸光帯と一致する第 1 の波長を有する第 1 の赤外線レーザービームを用意することであって、前記第 1 の構成要素は、前記被覆研磨物品の厚さの 1 マイクロメートル当たり少なくとも 0.01 である、第 1 の波長における第 1 の吸光度を有することと、

前記第 1 の構成要素の一部を、前記第 1 の赤外線レーザービームでアブレーションすることと、を含む方法。

【請求項 3】

少なくとも 1 種の結合剤によって裏材の第 1 の主表面に固定される研磨粒子を含む被覆研磨物品を用意することと、

第 1 の波長を有する第 1 の赤外線レーザービームを用意することとであって、前記被覆研磨物品は、第 1 の構成要素の厚さの 1 マイクロメートル当たり少なくとも 0.01 であ

る、前記第 1 の波長における第 1 の吸光度を有する第 1 の構成要素を有することと、

前記第 1 の構成要素の一部を、前記第 1 の赤外線レーザービームでアブレーションすることと、

前記第 1 の波長と異なる第 2 の波長を有する第 2 の赤外線レーザービームを用意することとであって、前記被覆研磨物品は、第 2 の構成要素の厚さの 1 マイクロメートル当たり少なくとも 0 . 0 1 である、前記第 2 の波長における第 2 の吸光度を有する第 2 の構成要素を有することと、

前記第 2 の構成要素の一部を、前記第 2 の赤外線レーザービームでアブレーションすることと、を含む方法。